

MANUFACTURE OF DIRECTIONAL COUPLER FOR POLARIZATION PLANE MAINTAINING OPTICAL FIBER

HITACHI CABLE LTD

Inventor(s): ; UETSUKA NAOTO
Application No. 59062015, Filed 19840328, Published 19851015

Abstract: PURPOSE: To shorten the time of a polishing process, to improve the productivity, to grasp the end of polishing securely and to improve the yield by polishing a surface of a glass substrate while monitoring transmission power continuously.

CONSTITUTION: The polarization plane maintaining optical fiber 2 is embedded in a groove formed in the surface of the glass substrate 1 to some curvature and stored in a polishing fixing jig 36, and then pressed against a polishing disk 32 with a weight 37 put thereupon. Further, light from a light source is made incident on the fiber 2 and while its transmitted light power is monitored by an analyzer 35 continuously, the surface of the substrate 1 is polished simultaneously with the scattering of abrasives. Then, the polishing is completed at the time of an abrupt decrease in the transmitted light power and polished surfaces of a couple of glass substrates after the polishing are set abutting on each other and joined together through a refracting index matching liquid, and they are fixed when a specific branching ratio is obtained by evanescent coupling.

COPYRIGHT: (C)1985, JPO& Japio

Int'l Class: G02B00628; G02B00616

MicroPatent Reference Number: 000003669

COPYRIGHT: (C)JPO

⑬日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

母公開特許公報(A)

昭60-203904

@Int_CI.4

識別記号

广内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)10月15日

G 02 B 6/28 6/16 A-8106-2H A-7370-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

◎発明の名称 偏波面保存光ファイバ方向性結合器の製造方法

②特 願 昭59-62015

❷出 願 昭59(1984)3月28日

44 00

日立市日高町5丁目1番地 日立電線株式会社電線研究所

内

⑪出 願 人 日立電線株式会社

20代 理 人 弁理士 佐藤 不二雄

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

明 細 1

- 1. 発明の名称 偏波面保存光ファイバ方向性結 合器の製造方法・
- 2. 特許請求の範囲
- 3. 発明の詳細な説明

〔発明の背景と目的〕

本発明は偏仮面保存光ファイバ方向性結合器の 製造方法に保り、特に生産性に優れ、かつ、歩留 りを大幅に向上するのに好適な 偏波面保存光ファ イバ方向性結合器の製造方法に関するものである。

ところで、従来は、基板1の製面の研磨にあたり、エパネッセント波領域に選したか否かは、研磨を一但中止し、基板1に埋め込んだ光ファイバ2に光を入射し、そのときの透過光パワーと研磨

转開昭60-203904 (2)

級面に光ファイバ2のコアの屈折率より10多程度大きい屈折率の整合液を塗つたときの透過光パワーの比を求めて研贈量の良否を推定していた。そのため、研磨終了までに非常に時間がかかり、また、場合によつてはコアまで研磨してしまい、光ファイバ2を破壊に至らしめることがあり、歩留りが扱かつた。

本発明は上記に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、生産性に優れ、かつ、歩留りを大幅に向上することができる偏波面保存光ファイバ方向性結合器の製造方法を提供することにある。

〔発明の概要〕

本発明の特徴は、ガラス基板の装面に形成した ある曲率の解に偏波面保存光ファイバを埋め込ん でから、その装面を上記光ファイバのコア内を伝 設する光のエバネッセント波領域に達するまで研 置するときに、上記光ファイバに光を入射し、そ の透過光パワーをモニタしながら研磨し、上記透 過光パワーが急激に減少したときに研磨終了とす るようにした点にある。

(実施例)

以下本発明の製造方法の一実施例を第3図、解: 4 図を用いて詳細に説明する。

第3図は本発明の製造方法の一実施例を説明するための装置の一例を示す斜視図で、31は光源、32は研磨板、33は研磨板32を回転駆動する研磨器、34は研磨板32上に散布した研磨剤、35は検光器、1はガラス基板で、表面に設けたある曲率の解に偏液の保存光ファイバ2が埋め込んであつて、その表面を研磨するため、研磨固定で研磨板32上に押しつけてある。光明31からの波域の保存光ファイバ2に入射させ、その透過によってがある。場次の保存光ファイバ2に入射させ、その透過によってが増減の場面を研磨板32で研磨剤34を散布しながら研磨する。

第4図は研鱈量と規格化された透過光パワーと

の関係を示す線図で、研磨量が光ファイバ2のコア内を伝搬する光のエパネッセント被が生ずる領域に選する最となると、研磨剤34の屈折率と研磨面の凹凸とにより、規格化透過光パワーが急激に小さくなる。したがつて、透過光パワーを検光器35で連続的に測定し、透過光パワーが急激に低下したら研磨終了とすれば、最適の研磨量の研磨を行うととができる。

そとで、本発明においては、基板1の投面を研 増するときに、光ファイバ2に光を入射して、そ の透過光パワーを検出器35で監視しながら研贈 し、透過光パワーが急激に低下したら研贈終了と するようにした。そして、その後は従来と同様に 研贈終了後の一対の基板1を結合して一体に固定 して偏波面保存光ファイバ方向性結合器とした。

なお、モニタする光の放長は、基板1 に埋め込んだ偏波面保存光ファイバ2のコア経、コアの屈 折率、比屈折率差に対して規格化剤改数が24以下となる放長であることが望ましい。

(発明の効果)

以上説明した本発明によれば、透過光パワーを 連続的にモニタしながらガラス基板の表面を研磨 すればよいので、研磨工程の時間が短かくなり、 生産性を向上することができ、かつ、研磨終了を 確実に把掘することができるので、歩留りを大幅 に向上することができるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

1 : ガラス基板、2 : 優波面保存光ファイバ、3 : 屈折率整合液、3 1 : 光源、3 2 : 研磨板、

33;研贈器、34;研贈剤、35;検光器。

代埋人 弁理士 佐 藤 不二雄



特周昭60-203904(3)









